

2024

1월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
01	02	03	04	05	06	07
08	09 Safety training	10	11	12 Safety training(T)	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23 Photolithography	24 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	25 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	26	27	28
29	30	31	01	02	03	04
05	06	메모:				

2024

2월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
29	30	31	01	02	03	04
05	06 Safety training	07	08 Safety training(T)	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20 Photolithography	21 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	22 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	23	24	25
26	27	28	29	01	02	03
04	05	메모:				

2024

3월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
26	27	28	29	01	02	03
04	05 Safety training	06	07	08 Safety training(T)	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19 Photolithography	20 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	21 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
01	02	메모:				

2024

4월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
01	02	03	04	05	06	07
08	09 Safety training	10	11	12 Safety training(T)	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23 Photolithography	24 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	25 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	26	27	28
29	30	01	02	03	04	05
06	07	메모:				

2024

5월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
29	30	01	02	03	04	05
06	07 Safety training	08	09	10 Safety training(T)	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21 Photolithography	22 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	23 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	24	25	26
27	28	29	30	31	01	02
03	04	메모:				

2024

6월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
27	28	29	30	31	01	02
03	04 Safety training	05	06	07 Safety training(T)	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18 Photolithography	19 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	20 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
01	02	메모:				

2024

7월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
01	02	03	04	05	06	07
08	09 Safety training	10	11	12 Safety training(T)	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23 Photolithography	24 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	25 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	26	27	28
29	30	31	01	02	03	04
05	06	메모:				

2024

8월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
29	30	31	01	02	03	04
05	06 Safety training	07	08	09 Safety training(T)	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20 Photolithography	21 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	22 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	23	24	25
26	27	28	29	30	31	01
02	03	메모:				

2024

9월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
26	27	28	29	30	31	01
02	03 Safety training	04	05	06 Safety training(T)	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24 Photolithography	25	26 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	27 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	28	29
30	01	메모: ※ 내부 사정에 따라 교육 일정 변경될 수 있음.				

2024

10월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
30	01	02	03	04	05	06
07	08 Safety training	09	10	11 Safety training(T)	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22 Photolithography	23 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	24 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	25	26	27
28	29	30	31	01	02	03
04	05	메모:				

2024

11월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
28	29	30	31	01	02	03
04	05 Safety training	06	07	08 Safety training(T)	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19 Photolithography	20 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	21 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	22	23	24
25	26	27	28	29	30	01
02	03	메모:				

2024

12월

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
25	26	27	28	29	30	01
02	03 Safety training	04	05	06 Safety training(T)	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17 Photolithography	18 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	19 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	메모:				